

量子科学技術研究開発機構施設共用 成果公表連絡票（学会等発表用）

本票には、課題 1 件、発表 1 件についてご記入ください。

提出日	2019 年 3 月 31 日			*発表資料及び発表日・開催場所を示すプログラム等の資料の写しを添えてください。
課題番号	2017A—K01	利用施設名	光量子科学研究施設	
		装置名(ビームライン等)	X線レーザー実験装置	
利用課題名	ダブルパルス照射による基板表面励起加工過程の調査に関する研究			
研究代表者 氏名	林 照剛	所属	九州大学	
<p>① 標題 (英語タイトルの場合は、その日本語訳もお書きください。)</p> <p>Dynamics of photo-excitation for the ablation of 4H-SiC substrate using femtosecond laser フェムト秒レーザーを用いた 4H-SiC の光励起加工プロセスの加工現象評価</p>				
<p>② 発表会議名</p> <p>The 9th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century (LEM21) .</p> <p style="text-align: center;">発表場所(開催都市) : 広島(広島国際会議場) 発表日 : 2017 年 11 月 14 日</p>				
<p>③ 著者(所属)</p> <p>松永啓伍(九州大学), 林照剛(九州大学), 黒河周平(九州大学), 横尾英昭(九州大学), 長谷川登(量子科学研究機構), 錦野将元(量子科学研究機構), 松川洋二(九州大学)</p>				
<p>④ 備考</p>				